

平井 義和 Yoshikazu HIRAI

京都大学 工学研究科マイクロエンジニアリング専攻 助教

Email address: hirai@me.kyoto-u.ac.jp

研究室HP

<http://www.nms.me.kyoto-u.ac.jp>



【専門】 ナノマイクロ加工、MEMS／センサ、マイクロ流体デバイス

1979年8月、京都府生まれ：京都府立峰山高等学校 卒業

2004年3月：立命館大学物質理工学専攻 博士前期課程 修了

2007年3月：京都大学工学研究科機械工学専攻 博士課程 修了 京都大学 博士(工学)

2007年4月～ 2009年3月：同大学工学研究科 博士研究員(科学技術振興)

2009年4月～ 2013年4月：同大学先端医工学研究ユニット 特定助教

2013年5月～ 現在：同大学工学研究科マイクロエンジニアリング専攻 助教

【プロジェクト、官公庁委員、編集委員など】

京都大学・キヤノン協働プロジェクト(2007年4月～2016年3月) ※医療機器開発に従事

電気学会・E部門会計(2016年6月～ 2018年5月)

文部科学省 科学技術政策研究所 科学技術予測センター 専門調査員(2013年～)

【受賞】 日本機械学会畠山賞(2002年)、電気学会第32回センサシンポジウム・五十嵐賞(2015年)、

Outstanding Reviewer Awards 2016(Journal of Micromechanics and Microengineering)、

電気学会 第73回電気学術振興賞 論文賞(2017年)

【趣味】 スポーツ観戦、乗り物系(電車・飛行機)、世界遺産巡り、ランニング